

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【公開番号】特開2004-14902(P2004-14902A)

【公開日】平成16年1月15日(2004.1.15)

【年通号数】公開・登録公報2004-002

【出願番号】特願2002-168192(P2002-168192)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/205

H 01 L 21/22

【F I】

H 01 L 21/205

H 01 L 21/22 501N

H 01 L 21/22 511Q

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月1日(2005.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体ウェハを熱処理する加熱炉の温度を検知する熱電対と、熱電対の検知情報に基づいて加熱炉の温度を制御する温度コントローラとを備えた半導体製造装置において、前記熱電対の検出温度に基づく所定の情報を無線回線を介して前記温度コントローラに供給することを特徴とする半導体製造装置。